Also published as:

JP3769995 (B2)



PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DEVICE

Publication number: JP2001075067 (A) Publication date: 2001-03-23 Inventor(s): MURAMATSU FIJI Applicant(s): SEIKO EPSON CORP

Classification: - international:

G02F1/13; G02F1/1333; G02F1/1335; G02F1/1341; G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/13

- European:

Application number: JP19990252205 19990906

Priority number(s): JP19990252205 19990906

Abstract of JP 2001075067 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to easily and rapidly produce a liquid crystal device by sticking polarizing plates to liquid crystal panels in the state of a middle-sized panels in a process for producing the liquid crystal device. SOLUTION: The large-sized panel structure including the plural liquid crystal panel portions is formed by bonding a first substrate base material formed with first electrodes for a plurality of the liquid crystal panels and a second substrate base material formed with second electrodes for a plural of the liquid crystal panels to each other (process P8); the middle-sized panels exposed with the liquid crystal injection ports for the plural liquid crystal panel components to the outside is formed by cutting the large-sized panel structure (procxess P9): liquid crystals are injected into the respective liquid crystal panel portions through the exposed liquid crystal injection ports (process P10); the polarizing plates are stuck to the respective liquid crystal panel portions of the middle-sized panel structure (process P12); and the middle-sized panel structure is divided into the individual liquid crystal panels after the polarizing plates are stuck thereto (process P13).



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer, So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]Like substrate impression plaster which forms oban panel structure which pastes together the 1st substrate base material with which the 1st electrode for two or more liquid crystal panel minutes was formed, and the 2nd substrate base material of each other with which the 2nd electrode for two or more liquid crystal panel minutes was formed, and contains two or more liquid crystal panel minutes was formed, and contains two or more liquid crystal panel portions. The 1st break process of forming seal panel structure while said oban panel structure while said oban panel structure while panel portions is outside exposed, A liquid crystal injection process which pours in a liquid crystal inside each liquid crystal panel portion through said exposed liquid crystal intel the xposed liquid crystal panel portion of said inside seal panel structure, and the 2nd break process of dividing said inside seal panel structure into each liquid crystal panel after the polarizing plate attachment process.

[Claim 2]A manufacturing method of a liquid crystal device establishing IC mounting step between said liquid crystal injection process and said polarizing plate attachment process, and mounting an IC chip in each liquid crystal panel portion of said inside seal panel structure in the IC mounting step in claim 1.

[Claim 3]A manufacturing method of a liquid crystal device, wherein an inside seal polarizing plate of a size for two or more liquid crystal panel minutes is stuck on each liquid crystal panel portion at least at said polarizing plate attachment process and said 2nd break process is performed after the pasting in claim 1 or claim 2.

[Claim 4]A manufacturing method of a liquid crystal device, wherein cutting is performed using a laser beam in any at least one of claim 1 to the claims 3 at said 2nd break process.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

 This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention relates to the manufacturing method of the liquid crystal device which displays images, such as a character, a number, and a pattern, by controlling the orientation of the liquid crystal closed between the substrates of a couple. [none]

Description of the Prior Art]A liquid crystal device is formed by generally attaching an accessory instrument called a lighting system. IC for a liquid crystal drive, etc. which are called a back light etc. to the liquid crystal panel of the structure which enclosed the liquid crystal between the substrates of a couple. Generally a liquid crystal panel pastes together the 1st substrate with which the 1st electrode was formed, and the 2nd substrate of each other with which the 2nd electrode was formed by a sealant, and is formed by enclosing a liquid crystal in the gap formed among those substrates, and what is called a cell gap.

[0003]As a method of manufacturing the above—mentioned liquid crystal device, the oban panel structure which contains two or more liquid crystal panel portions combining mutually the 1st substrate base material with which the 1st electrode for two or more liquid crystal panel minutes was formed, and the 2nd substrate base material with which the 2nd electrode for two or more liquid crystal panel minutes was formed is formed conventionally, Next, the inside seal panel structure of the structure which cuts said oban panel structure and the liquid crystal inlet of two or more of said liquid crystal panel portions exposes outside is formed, Next, a liquid crystal is poured in inside each liquid crystal panel portion through the exposed aforementioned liquid crystal inlet, then said inside seal panel structure is divided into each liquid crystal panel, and the manufacturing method which comprises a series of processes of next sticking a polarizing plate on each divided aforementioned liquid crystal panel is known.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]However, in the manufacturing method of the abovementioned conventional liquid crystal device, since the polarizing plate was stuck on each liquid crystal panels of those after dividing inside seal panel structure into each liquid crystal panel, there was a problem of the pasting process of a polarizing plate having been troublesome and taking time.

[0005]This invention was accomplished in view of the above-mentioned problem, and is *****. By improving the attachment process of the polarizing plate in the manufacturing method of **, the purpose is enabling it to manufacture a liquid crystal device simply and promptly.

[00006]

[Means for Solving the Problem](1) In order to attain the above-mentioned purpose, a manufacturing method of a liquid crystal device concerning this invention, Like substrate impression plaster which forms oban panel structure which pastes together the 1st substrate base material with which the 1st electrode for two or more liquid crystal panel minutes was formed, and the 2nd substrate base material of each other with which the 2nd electrode for two or more liquid crystal panel minutes was formed, and contains two or more liquid crystal panel

portions, The 1st break process of forming seal panel structure while said oban panel structure is cut and a liquid crystal inlet of two or more of said liquid crystal panel portions is outside exposed, A liquid crystal injection process which pours in a liquid orystal inside each liquid crystal panel portion through said exposed liquid crystal inlet, It has a polarizing plate attachment process of sticking a polarizing plate on each liquid crystal panel portion of said inside seal panel structure, and the 2nd break process of dividing said inside seal panel structure into each liquid crystal panel after the polarizing plate attachment process.

[0007]According to the manufacturing method of this liquid crystal device, after a liquid crystal panel is divided separately, one polarizing plate is not stuck on a liquid orystal panel of these each at a time, Since a polarizing plate is stuck to a liquid crystal panel of a state of inside seal panel structure, it is simplified remarkably and an attachment process of a polarizing plate at the time of manufacturing a liquid crystal device becomes possible [manufacturing a liquid crystal device simbly and promptly therefore].

Govice simply and prompty therefore J. [0008](2) About a manufacturing method of a liquid crystal device of the above-mentioned composition, IC mounting step can be established between said liquid crystal injection process and said polarizing plate attachment process, and an IC chip can be mounted in each liquid crystal panel portion of said inside seal panel structure in the IC mounting step. [0009]Structure of mounting an IC chip in at least one surface of the substrates of a couple which constitutes a liquid crystal device directly according to this composition of (2), It is simplified remarkably and, therefore, a mounting step of an IC chip at the time of manufacturing the so-called liquid crystal device of a COG (Chip OnGlass) method becomes possible [manufacturing a liquid crystal device of the COG method concerned simply and promptly]. [0010](3) In a manufacturing method of a liquid crystal device of the above-mentioned composition, at said polarizing plate attachment process, an inside seal polarizing plate of a size for two or more liquid crystal panel minutes is stuck on each liquid crystal panel portion at least, and said 2nd break process is performed after the pasting.

[0011] In a polarizing plate attachment process in a manufacturing method of a liquid crystal device of composition of the above (1), Can also stick a polarizing plate of a size for one liquid crystal panel or each liquid crystal panel portion contained in inside seal panel structure separately, or like composition of a book (3), After sticking an inside seal pelarizing plate of a size for two or more liquid crystal panel minutes on inside seal panel structure at least, while being stuck on the inside seal penal structure and it, the 2nd break can cut both seal polarizing plates, and each liquid crystal panel can also be cut down.

[0012]According to this composition of (3), it becomes possible to be able to do now more attachment work of a polarizing plate in a polarizing plate in the activation of the still more simply and promptly, and to manufacture a liquid crystal device still more simply and promptly more as a result compared with a case where a polarizing plate for one liquid crystal panel is stuck individually.

[0013](4) About cutting of panel structure, a slot called a scribe groove to substrates, such as glass and a plastic, is formed, and cutting process that power divides a substrate on the basis of the scribe groove is known widely. However, it can replace with this cutting process and panel structure can also be cut using a laser beam.

[0014]When structure of the above (3) of cutting both a polarizing plate and a substrate is adopted according to cutting process using this laser beam, those both can be cut correctly convenient.

[0015]By the way, in outting using a scribe groove, there is a possibility that a minute crack called a micro crack to a outting plane of a liquid crystal panel formed by that outting may occur, and a crack may occur in a liquid crystal panel on the basis of this micro crack.

[0016]On the other hand, if a substrate of a liquid crystal panel is cut using a laser beam, a cutting plane of the substrate will become it is remarkable and smooth compared with a case where a scribing method is used, and will not generate a micro crack, either. Therefore, damage to a liquid crystal panel can be prevented beforehand.

[0017]

[Embodiment of the Invention] Before explaining the manufacturing method of the liquid crystal

device concerning this invention, the liquid crystal device which uses the manufacturing method and is produced is explained first <u>Drawing 1</u> shows one embodiment of the liquid crystal device. This liquid crystal device 1 is formed by mounting IC3 for a liquid crystal drive as an IC chip in the liquid crystal panel 2. A lighting system, a light reflection plate, etc. which are called a back light etc. are formed in one field of the liquid crystal panel 2 if needed.

[0018]The liquid crystal panel 2 has the substrates 4a and 4b of the couple which counters mutually, and those circumferences paste up these substrates of each other by the sealant 7. These substrates 4a and 4b are produced by forming an electrode and other required elements in the board material formed, for example with a hard light transmittance state material called glass etc., the light transmittance state material which has flexibility called a plastic etc., etc. [0019]In <u>drawing 2</u>, the 1st electrode 9a that acts on the liquid crystal side surface of the board material 8a of the 1st substrate 4a, i.e., the field which counters the 2nd substrate 4b, for example as a common electrode is formed in a predetermined pattern, the overcoat layer 11a is formed on it, and the orienting film 12a is further formed on it. The polarizing plate 6a is stuck on the outer surface of the board material 8a.

[0020] To the liquid crystal side surface of the board material 8b of the 2nd substrate 4b that counters the 1st substrate 4a, i.e., the field which counters the 1st substrate 4a. For example, the 2nd electrode 9b that acts as a segment electrode is formed in a predetermined pattern, the overcoat layer 11b is formed on it, and the orienting film 12b is further formed on it. The polarizing plate 6b is stuck on the outer surface of the board material 8b.

[0021]The 1st electrode 9a and the 2nd electrode 9b are formed in a thickness of about 1000 A, for example with transparent electrodes, such as ITO (Indium Tin Oxide), The overcoat layers 11a and 11b are formed in a thickness of about 800 A, for example with oxidized silicon, titanium oxide, or those mixtures, and the orienting films 12a and 12b are formed in a thickness of about 800 A, for example with polyimide system resin.

[0022]As shown in <u>drawing 1</u>, the 1st electrode 9a by arranging two or more straight line patterns of each other in parallel, It is formed in what is called stripe shape, and, on the other hand, the 2nd electrode 9b is too formed in stripe shape by arranging two or more straight line patterns of each other in parallel so that the 1st electrode 9a of the above may be intersected. Two or more points that these electrodes 9a and electrodes 9b cross in the shape of a dot matrix form the pixel for displaying an image. And the field section forming is carried out [a field] by the pixel of these plurality turns into a viewing area for displaying the image of a character etc.

[0023]Two or more spacers 13 are distributed by the liquid crystal side surface of either one of [which was formed as mentioned above] the 1st substrate 4a and the 2nd substrate 4b, and as shown in drawing 2, as the sealant 7 shows drawing 1-by printing etc. further in the liquid crystal side surface of one of substrates, it is provided in it at frame shape. Inside this sealant 7, as shown in drawing 2, the flow material 16 is distributed. As shown in drawing 1, the liquid crystal inlet 7 a is formed in a part of sealant 7.

[0024]Among both the boards 4a and 4b, the uniform size held by the spacer 13, for example, an about 5-micrometer gap, and what is called a cell gap are formed, the liquid crystal 14 is poured in into the cell gap through the liquid crystal inlet 7a, and the liquid crystal inlet 7a is closed with resin etc. after completion of the pouring.

[0025]In <u>drawing 1</u>, the 1st substrate 4a has the extending substrate part 4c projected to the outside of the 2nd substrate 4b, the 1st electrode 9a on the 1st substrate 4a is directly prolonged to the extending substrate part 4c, and comes out of it to it, and serves as the circuit pattern 15. The 2nd electrode 9b on the 2nd substrate 4b is connected to the circuit pattern 15 on the extending substrate part 4c via the flow material 16 (refer to <u>drawing 2</u>) distributed inside the sealant 7. The numerals 20 show the external connection terminal for taking electric connection between the external circuits which are not illustrated.

[0026]Although many books are formed throughout the surface of each substrate 4a and 4b at a actual very narrow interval, the circuit pattern 15 and the external connection terminal 20 which are prolonged from each electrodes 9a and 9b and them, In each figure to be explained drawnal and from now on, in order to show structure intelligibly, those electrodes are typically illustrated

at an interval larger than a actual interval, and the graphic display of some [further] electrodes is o mitted. The electrodes 9a and 9b formed in the field where a liquid crystal is enclosed may not be restricted to being formed in linear shape, but may be formed in proper pattern state. [0027]In drawing1, the vamp 21 as an IC side edge child is formed in the active face 3a of IC3 for a liquid crystal drive. In this embodiment, the liquid crystal drive cof what is called a COG (Chip On Glass) method of the structure of mounting IC3 for a liquid crystal drive directly on the extending substrate part 4c of the liquid crystal panel 2 will be considered. IC3 for a liquid crystal drive is faced mounting on the extending substrate part 4c. To first, IC mounted region J which is a field which should mount IC3 for a liquid crystal drive, and is a field of the almost same area as the IC3. ACF/Anisotropic Conductive Film: anisotropic conducting film) 17 as a charge of adhesion material is stuck, subsequently to ACF17 the active face 3a of IC3 for a liquid crystal drive is carried out to IC mounted region J.

[0028] As it is an existing high polymer film of the conductivity used in order that ACF17 may give anisotropy and may make package connection of between the terminals of a couple electrically as everyone knows, for example, is shown in drawing 2, It is formed by distributing many electric conduction particles 19 into the thermoplastic or thermosetting resin film 22. [0029]Paste up IC3 for a liquid crystal drive on the extending substrate part 4c by pressurizing the extending substrate part 4c and IC3 for a liquid crystal drive under thermo compression bonding, i.e., heating, on both sides of this ACF17, and Connection which has unidirectional conductivity between between the vamp 21 of IC3 for a liquid crystal drive and the circuit patterns 15 on the extending substrate part 4c and the vamp 21 of IC3 for a liquid crystal drive, and the external connection terminal 20 on the extending substrate part 4c is made. [0030] Scanning voltage is impressed for every line about the liquid crystal device 1 constituted as mentioned above to either one of the 1st electrode 9a or the 2nd electrode 9b by IC3 for a liquid crystal drive. By furthermore impressing the data voltage based on a display image for every pixel to another side of those electrodes, images [carry out light modulation, have and / outside / the substrate 4a or / of 4b] for which each picture element part with selected impression of both voltage is passed, such as a character and a number, are displayed. [0031]About the manufacturing method for manufacturing hereafter the liquid crystal device 1 which comprises the above-mentioned composition, process drawing shown in drawing 3 is made reference, and is explained.

[0032]First, to each liquid crystal panel board part 4a of the 1st large-sized substrate base material 18a of the 1st substrate 4a that constitutes the liquid crystal panel 2 that has two or more sizes of a part, as shown in <u>drawing 4</u>, as shown in <u>drawing 6</u>(a), The 1st electrode 9a, the circuit pattern 15, and the external connection terminal 20 are formed by a well-known pattern formation method, for example, the photolithographic method, by being made from ITO (process P1 of <u>drawing 3</u>). It is set to IC mounted region J for the field in which the tips of the circuit pattern 15 and the external connection terminal 20 gather in <u>drawing 6</u>(a) to mount IC3 (refer to <u>drawing 1</u>) for a liquid crystal drive.

[0033]Next, the overcoat layer 11a (refer to <u>drawing 2</u>) is used as oxidized silicon, and it forms by offset printing, for example by being made from titanium oxide on the surface of the 1st substrate base material 18 as of <u>drawing 4</u> (process P2 of <u>drawing 3</u>). And on it, the orienting film 12a (refer to <u>drawing 2</u>) is formed by offset printing, for example by being made from polyimide system resin (process P3 of <u>drawing 3</u>). Furthermore on it, the sealant 7 is formed by screenstencil at frame shape using the material which distributes flow material, for example in epoxy system resin (process P4 of <u>drawing 3</u>). Thereby, the 1st large-sized substrate base material 18a as shown in <u>drawing 4</u> is formed. In <u>drawing 4</u>, the graphic display of the overcoat layer and the orienting film is omitted for convenience.

[0034]On the other hand, to each liquid crystal panel board part 4b of the 2nd large-sized substrate base material 18b of the 2nd substrate 4b that constitutes the liquid crystal panel 2 that has two or more sizes of a part, as shown in <u>drawing 5</u>, as shown in <u>drawing 6</u> (b), The 2nd electrode 9b is formed by a well-known pattern formation method, for example, the photolithographic method, by being made from ITO (process P5 of drawing 3).

[0035]Next, the overcoat layer 11b (refer to <u>drawing 2</u>) is used as oxidized silicon, and it forms by offset printing, for example by being made from titanium oxide on the surface of the 2nd substrate base material 18b of <u>drawing 5</u> (process P6 of <u>drawing 3</u>). And on it, the orienting film 12b (refer to <u>drawing 2</u>) is formed by offset printing, for example by being made from polyimide system resin (process P7 of <u>drawing 3</u>). Thereby, the 2nd large-sized substrate base material 18b as shown in <u>drawing 5</u> is formed. In <u>drawing 5</u>, the graphic display of the overcoat layer and the orienting film is omitted for convenience.

[0036]In the process P8 of drer the 1st substrate base material 18a drawing.1) were produced by the above, Both boards of each other are pasted together piling up the 1st substrate base material 18b on both sides of the sealant 7 in between, and being stuck further by pressure, i.e., by pressurizing under heating.

[0037]By this lamination, the tip (refer to dreaming 6, (b)) of the 2nd electrode 8b on the 2nd substrate 4b and the circuit pattern 15 (refer to dreaming 6, (a)) on the 1st substrate 4a are mutually connected conductively by the flow material 16 (refer to dreaming 2) distributed in the sealant 7. Of the above, the oban panel structure of the size containing two or more liquid crystal panels 2 is formed. When pasting together the 1st substrate base material 18a and the 2nd substrate base material 18b, where either of the 2nd substrate base material 18b shown in the 1st substrate base material 18a shown in dreaming 6 is over turned from the state of a graphic diselay, it sticks with other substrate base materials.

[0038]After large-sized panel structure is produced as mentioned above, the 1st break process is carried out to this panel structure (process P9 of <u>drawing 3</u>). This substrate base material is out along the 1st cutout line L10 specifically shown in <u>drawing 4</u> about the 1st substrate base material 18 a that constitutes panel structure, and, on the other hand, this substrate base material is cut along the 1st cutout line L11 shown in <u>drawing 5</u> about the 2nd substrate base material 1st.

[0039]Thereby, as shown in <u>drawing 7</u>, two or more inside seal panel structure in state where strip-of-paper-like [I sts substrate base material 18a] and strip-of-paper-like 2nd substrate base material 18b were stuck mutually 2' is produced. About inside seal panel structure of these 2', the liquid crystal inlet 7a of each liquid crystal panel portion contained in them has structure exposed to the exterior.

[D040]Cutting of the panel structure in the process P9 can be performed, for example using the scribe method, the laser cutting method, etc. The scribe method is the method of dividing panel structure in the place of the cutout lines L10 and L11 by forming a scribe groove, i.e., a cut groove, along the cutout line L10 and the cutout line L11, and striking panel structure from the back side of those scribe grooves.

[0041]By carrying out scanning movement of the laser beam discharged from the laser launcher 23, for example, the infrared-laser-light R, like the arrow A on the 1st substrate base material 18b are the 2nd substrate base material 18b, as the laser cutting method is typically shown in drawing 8, It is the method of dividing the substrate base material 18a or 18b from the place where the laser beam R hit.

[0042]A liquid crystal is poured in through the liquid crystal inlet 7a exposed to the exterior about two or more liquid crystal panel portions contained in it after inside seal panel structure 2' (drawing 7) is produced as mentioned above, and the liquid crystal inlet 7a is further closed with resin after completion of the pouring (process P10 of drawing 3).

[0043]Then, ACF17 is stuck on IC mounted region J of each liquid crystal panel portion, IC3 for a liquid crystal drive is mounted in IC mounted region J of each liquid crystal panel portion by carrying out attachment of IC3 for a liquid crystal drive, i.e., masking arrival, on the ACF17 furthermore, and pressing those IC3 for a liquid crystal drive by the crimping head heated further (process P11 of drawing 3).

[0044]Next, it sticks on the outer surface of 1st substrate base material 18a' of an inside seal, and 2nd substrate base material 18b', respectively in the inside seal polarizing plates 6a and 6b of the size which can cover two or more liquid crystal panel portions contained in inside seal panel structure 2' (process P12 of drawing 3). And in the process P13, the 2nd break is

performed to inside seal panel structure 2' after that. [0045] That is, in drawing 1, both 1st substrate base material 18a' and 2nd substrate base material 18b' are cut together in the polarizing plates 6a and 6b along the 2nd cutout line L2, and, thereby, the one liquid crystal device 1 shown in drawing 1 is divided at a time. Although this 2nd break can also be performed using various kinds of intercept methods, such as the scribe

2nd break can also be performed using various kinds of intercept methods, such as the scribe method and the laser cutting method, it cuts desirably using the laser cutting method. [D046]laser — a cut — a method — having used — a direction — it is desirable — things — a reason — the — one — a polarizing plate — six — a — ' — six — b — ' — a substrate — 18 — a — ' — 18 — b — ' — both — convenient — exact — it can cut — things — it is . It is as the 2nd follows [the reason]. Namely, in using the scribe method, the minute crack called a micro crack to the cutting plane of a liquid crystal panel substrate occurs, it is because the cutting plane of a liquid crystal panel substrate becomes it is remarkable and smooth compared with the case where the scribe method is used and damage to a liquid crystal panel can therefore be beforehand prevented, if the laser cutting method is used for a liquid crystal panel

to there being a possibility that a crack may occur on the basis of this micro crack. [0047](Other embodiments) although the desirable embodiment was mentioned and this invention was explained above, this invention is not limited to the embodiment, within the limits of the invention indicated to the claim, is boiled variously and can be changed.

[0048]For example, although the liquid crystal device of the COG method of the structure of mounting IC3 for a liquid crystal drive directly on the substrate 4a or 4b was illustrated in the above explanation, After producing a liquid crystal panel, in the process of manufacturing a liquid crystal panel about the liquid crystal device of structure which connects IC3 for a liquid crystal drive to a liquid crystal panel by FPC (Flexible Printed Circuit), this invention is applicable. [0049]In the above-mentioned embodiment, as shown in drawing.7, stuck on panel structure 2' of an inside seal in the polarizing plate and panel structure 2' together after that, but. In the polarizing plate and panel structure 2' together after that, but. In the polarizing plate attachment process (process P12) of drawing.3, the polarizing plate of the size for one liquid crystal panel is individually stuck on rear surface both sides of each liquid crystal panel potron of panel structure 2' is also considered at the 2nd break process (process P13).

[Effect of the Invention] According to the manufacturing method of the liquid crystal device concerning this invention, after a liquid crystal panel is divided separately, one polarizing plate is not stuck on the liquid crystal panel of these each at a time, Since a polarizing plate is stuck to the liquid crystal panel of the state of inside seal panel structure, the attachment process of the polarizing plate at the time of manufacturing a liquid crystal device is simplified remarkably, and, therefore, a liquid crystal device can be manufactured simply and promptly.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-75067 (P2001-75067A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
G02F	1/13	101	G02F	1/13	101	2H088	
	1/1335	510		1/1335	510	2H089	
	1/1341			1/1341		214091	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全8 頁)

(21)出願番号	特職平11-252205	(71) 出職人 000002369
(22)出版日	平成11年9月6日(1999.9.6)	セイコーエアノン株公会社 東京教育所は国際省 2 丁目 4 番 1 号 (72)発明者 材松 永至 長年東郷防市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコ ーエアノン株公会社内 (74)代理 100053888 小理士 鈴木 第三郎 (外 2 名) ドターム(参考) 20088 FA05 FA10 MA01 EA06 BA18 MA20 20088 FA10 MA21 MA53 MA55 QA12 TA01 TA07 TA15 20091 FANK FA082 FC16 GA01 CA09 LA12

(54) [発明の名称] 被晶装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 液晶装置の製造方法における偏光板の貼付け 工程を改善することにより、液晶装置の製造を簡単且つ 迅速に行なえるようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶パネル複数分の第1電極が形成され た第1基板母材と液晶バネル複数分の第2電極が形成さ れた第2基板母材とを互いに貼り合わせて複数の液晶パ ネル部分を含む大判パネル構造を形成する基板組付け工 程と、

前記大判パネル構造を切断して前記複数の液晶パネル部 分の液晶注入口が外部に露出する中判パネル構造を形成 する第1プレイク工程と、

露出した前記液晶注入口を通して各液晶パネル部分の内 部へ被晶を注入する液晶注入工程と、

前記中判パネル構造の各液晶パネル部分に偏光板を貼付 する偏光板貼付け工程と、

その偏光板貼付け工程の後に前記中判パネル構造を個々 の液晶パネルに分割する第2ブレイク工程とを有するこ とを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項2】 請求項1において、前記液晶注入工程と 前記偏光板貼付け工程との間にIC実装工程を設け、そ のIC実装工程において前記中判パネル構造の各液晶パ ネル部分にICチップを実装することを特徴とする液晶 装置の製造方法。

【請求項3】 請求項1又は請求項2において、前記偏 光板貼付け工程では少なくとも液晶パネル複数分の大き さの中判偏光板が各液晶パネル部分に貼付され、その比 付後に前記第2プレイク工程が行われることを特徴とす る液晶装置の製造方法。

【請求項4】 請求項1から請求項3の少なくともいず れか1つにおいて、前記第2プレイク工程ではレーザ光 線を用いて切断が行われることを特徴とする液品装置の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、一対の基板間に封 止した液晶の配向を制御することによって文字、数字、 絵柄等といった像を表示する液晶装置の製造方法に関す **5**.

[0002]

【従来の技術】液晶装置は、一般に、一対の基板間に液 晶を封入した構造の液晶パネルに、バックライト等とい った照明装置や液晶駆動用IC等といった付帯機器を付 40 設することによって形成される。また、液晶パネルは、 一般に、第1電極が形成された第1基板と第2電極が形 成された第2基板とをシール材によって互いに貼り合わ せ、それらの基板間に形成される間隙、いわゆるセルギ ャップ内に被晶を封入することによって形成される。 【0003】上記の液晶装置を製造する方法として、従

来、液晶パネル複数分の第1電極が形成された第1基板 母材と液晶パネル複数分の第2電極が形成された第2基 板母材とを互いに組み合わせて複数の液晶パネル部分を を切断して前記複数の液晶パネル部分の液晶注入口が外 部に露出する構造の中判パネル構造を形成し、次に前記 の露出した液晶注入口を通して各液晶パネル部分の内部 へ液晶を注入し、次に前記中判パネル構造を個々の液晶 パネルに分割し、次に前記の分割された個々の液晶パネ ルに偏光板を貼付するという一連の工程から成る製造方 法が知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記從 来の液晶装置の製造方法においては、中判パネル構造を 個々の液晶パネルに分割した後にそれらの個々の液晶パ ネルに偏光板を貼付していたので、偏光板の貼付工程が 面倒で時間がかかるという問題があった。

【0005】本発明は、上記の問題点に鑑みて成された ものであって、液晶装置の製造方法における偏光板の貼 付け工程を改善することにより、液晶装置の製造を簡単 且つ迅速に行なえるようにすることを目的とする。 [0006]

【課題を解決するための手段】(1) 上記の目的を達

成するため、本発明に係る液晶装置の製造方法は、液晶 パネル複数分の第1電極が形成された第1基板母材と被 品パネル複数分の第2電極が形成された第2基板母材と を互いに貼り合わせて複数の液晶パネル部分を含む大判 パネル構造を形成する基板組付け工程と、前記大判パネ ル構造を切断して前記複数の液晶パネル部分の液晶注入 口が外部に露出する中判パネル構造を形成する第1ブレ イク工程と、露出した前記液晶注入口を通して各液晶パ ネル部分の内部へ液晶を注入する液晶注入工程と、前記 中判パネル構造の各液晶パネル部分に偏光板を貼付する 30 偏光板貼付け工程と、その偏光板貼付け工程の後に前記 中判パネル構造を個々の液晶パネルに分割する第2ブレ

イク工程とを有することを特徴とする。 【0007】この液晶装置の製造方法によれば、液晶パ ネルが個々に分割された後にそれら個々の液晶パネルに 偏光板が1個ずつ貼り付けられるのではなく、偏光板は 中判パネル構造の状態の液晶パネルに対して貼り付けら れるので、液晶装置を製造する際の偏光板の貼付け工程 が著しく簡略化され、よって液晶装置の製造を簡単1つ

迅速に行うことが可能となる。 【0008】(2) 上記構成の液晶装置の製造方法に 関しては、前記液晶注入工程と前記偏光板貼付け工程と の間にIC実装工程を設け、そのIC実装工程において 前記中判パネル構造の各被晶パネル部分にICチップを 実装することができる。

【0009】この(2)の構成によれば、液晶装置を構 成する一対の基板のうちの少なくとも一方の表面にIC チップを直接に実装する構造の、いわゆるCOG (Chin OnGlass) 方式の液晶装置を製造する際のICチップの 実装工程が著しく簡略化され、よって、当該COG方式 含む大判パネル構造を形成し、次に前記大判パネル構造 50 の液晶装置の製造を簡単且つ迅速に行うことが可能とな

貼着される。

る。 【0010】(3) 上記構成の液晶装置の製造方法に おいて、前記偏光板貼付け工程では少なくとも液晶パネ ル複数分の大きさの中製備光板が各液晶パネル部分に貼 付され、その貼付後に前記第2プレイク工程が行われる ことを整備とする。

3

[0011]上記(1)の構成の混晶装置の製造方法に 認ける個光板貼付け工程においては、液晶パネル1個分 の大ききの偏光板を中型パネル機造に含まれる全線晶パ ネル銀分に個々に貼り付けることもできるし、あるいは 本(3)の構成のように、少なくとも液晶パネル複数分 分さきの中型偏光板を中型パネル機造に貼付した後、 その中型パネル構造及びそれに貼り付けられた中型偏光 板の周方を第2フレイクによって切断して個々の液晶パネルを切り出てこともできる。

[0012] この(3)の構成によれば、液晶ベネル1 個分の輸送板を借別に貼り付ける場合に比べて、(単光板 貼付け工程における領光板の貼付け体薬をより一層簡単 且つ迅速に行うことができるようになり、その結果、液 晶装置の製造をより一層簡単且つ迅速に行うことが可能 となる。

[0013] (4) パネ・構造の切断については、ガラス、ブラスチック等の高松にスタライブ溝と呼ばれる 溝を形成し、そのスクライブ溝を基準にして基板を は、そのスクライブ溝を基準にして基板とは、 は、ローザ光線を用い てパネル構造を切断することもできる。

【0014】このレーザ光線を用いた切断方法によれば、偏光板と基板との両方を切断するという上記(3)の構造を採用した場合に、それらの両方を支除なく正確 30に切断することができる。

[0015] ところで、スクライブ簿を使って切断を行 う場合には、その切断によって形成された液晶パネルの 切断面にはマイクロクラックと呼ばれる酸かなクラック が発生し、このマイクロクラックを基点として液晶パネ ルに亀製が発生するおそれがある。

【0016】これに対し、レーザ光線を用いて液晶パネルの基度を切断するようにすれば、その基板の切断面はスラモダンブ方法を用いた場合に比べて著しく滑らかとなり、マイクロクラックも発生しない。よって、液晶パネ 40ルの環像を米然に防止できる。

[0017]

【発明の実施の形態】本売明に係る被高級整の製成方法 を説明する前に、まず、その製造方法を月11・イ下製され る液流設置について説明する。図1は、その液流設置の 一実施形態を示している。この液晶接触11に3を実施する ことによって形成される。また、液晶ペネル2の一方の 面には、必要に応じて、バックライト等といった照明装 僅や光度対域を対象けられる。 【0018】 統晶パネル2は、互いに対向する一対の基 版4 a 及び4 b を有し、これらの基板はシール村でによってそれらの周囲が互いに接着される。これらの基板は かした。例とばガラス等といった接質な光過過性 材料や、プラステック等といった可憐性を有する光過過 性材料等によって形成された基板素料に配種その他の必 要要素者形成することによって採りまれる。

【0019】図2において、第1整仮4aの基度兼収表 aの核晶側表面、すなわち第2差板4bに対向する面に は、例えばコモン種板として作用する第1電板9aが所 定のパターンに形成され、その上にだーバーコート層1 1aが形成され、さらにその上に配向版12aが形成した。また、基板兼付8aの外側変質には備光板6aが

 $\left[0020\right]$ 第1基板4 a に対向する第2基板4 b の基板素材 8 b の混晶倒表面、すなわち第1基板4 a に対向する面には、例えばセグメント電極として作用する第2電極9 b が所定のパターンに形成され、その上にオーバーコート層 11 b が形成され、さらにその上に配向膜1

ーコート層11bが形成され、さらにその上に配向膜12bが形成される。また、基板素材8bの外側表面には 偏光板6bが貼着される。

【0021】第1電機等。及び第2階階9 bは、例えば TO (Indium Tin Oxide) 等の透明電極によって10 00オングストローム程度の原きに形成され、オーバー コート層11 a及び11 bは、例えば酸化性薬、酸化テ 少又以てはれるの配合物等によって800オングストローム程度の厚きに形成され、そして配向際12 a及び1 2 bは、例えば切りイミド湯樹脂によって800オングストローム程度の夢さ形成を1分

『 【0022】第1電極9aは、図1に示すように、複数の直線パターンを至いに平行に配列することによって、いわゆるストライプ状に形成され、一方、第2電極9bは上記房1電極9aに交差するように複数の直線パターンを互いに平行に配列することによって、やはりストライプ状に形成される。これらの電極9aと電極9bストライプ状に形成される。これらの電極9aと電極9bストラインない交差する複数の点が、像を表示するための画響を形成する。そして、それら複数の画素によって区面形成される関域が、文字等といった像を表示するための無条を形成する。そして、それら複数の画素によって区面形成される関域が、文字等といった像を表示するための表示関域をとなって、

10023】以上のようにして形成された第1基板は、 及び第2基板45のいずれか一方の磁急側接面には、 2に示すように、複数のスペーサ13が分散され、さら にいずれか一方の基度の磁品側接面にシールはすが何点と は印刷等によって図1に示すように体表に取けられる。 このシール材7の内部には図2に示すように導通材16 が分散される。また、シール材7の一部には図1に示す ように感過性入り73が振される。

[0024] 両基板4a及び4bの間にはスペーサ13 によって保持される均一な寸法、例えば5μm程度の間 50 隙、いわゆるセルギャップが形成され、液墨注入口7a

5 を通してそのセルギャップ内に液晶14が注入され、そ の注入の完了後、液晶注入ロ7aが樹脂等によって封止

される。

【0025】図1において、第1基板4aは第2基板4 bの外側へ張り出す基板張出し部4cを有し、第1基板 4 a 上の第1電極9 a はその基板張出し部4 c へ直接に 延び出て配線パターン15となっている。また、第2基 板4 b上の第2電極9 bは、シール材7の内部に分散し た導通材16 (図2参照)を介して、基板張出し部4 c 上の配線パターン15に接続している。符号20は、図 10 示しない外部回路との間で電気的な接続をとるための外 部接続端子を示している。

【0026】各閣極9a及び9b、それらから延びる配 線パターン15並びに外部接続端子20は、実際には極 めて狭い間隔で多数本がそれぞれの基板4a及び4bの 表面全域に形成されるが、図1及びこれから説明する各 図では構造を分かり易く示すために実際の間隔よりも広 い間隔でそれらの電極等を模式的に図示し、さらに一部 の電極の図示は省略してある。また、液晶が耐入される 領域内に形成される電極9a及び9bは、直線状に形成 20 の[C実装領域]になる。 されることに限られず、適宜のパターン状に形成される こともある。

【0027】図1において、液晶駆動用IC3の能動面 3 aには、IC側端子としてのバンプ21が形成され、 る。本実施形態では液晶駆動用1C3を液晶パネル2の 基板張出し部4cの上に直接に実装する構造の、いわゆ るCOG (Chip On Glass) 方式の液晶装置を考えるこ とにする。液晶駆動用 I C 3 を基板張出し部 4 c の上に 実装するに際しては、まず、液晶駆動用IC3を実装す べき領域であってそのIC3とほぼ同じ面積の領域である(るIC実装領域IC、接着用材料としてのACF (Anis otropic Conductive Film: 異方性導電膜) 17を贴着 し、次いで液晶駆動用IC3の能動面3aをACF17 に貼り付け、これにより液晶駆動用IC3をIC実装領 城」に仮装着する。

【0028】ACF17は、周知の通り、一対の機子間 を異方性を持たせて電気的に一括接続するために用いら れる導電性のある高分子フィルムであって、例えば図2 に示すように、熱可塑性又は熱硬化性の樹脂フィルム2 形成される。

【0029】このACF17を挟んで基板得出し部4c と液晶駆動用IC3とを熱圧着、すなわち加熱下で加圧 することにより、液晶駆動用 I C 3 を基板張出し部 4 c に接着すると共に、液晶駆動用 I C 3 のバンプ 2 1 と基 板張出し部4 c上の配線パターン15との間及び液晶駆 動用IC3のパンプ21と基板提出し部4cトの外部接 続端子20との間において単一方向の薄電性を持つ接続 を実現する。

て、液晶駆動用IC3によって第1電極9a又は第2電 極9bのいずれか一方に対して行ごとに走査電圧を印加 し、さらにそれらの電極の他方に対して表示画像に基づ いたデータ電圧を衝素ごとに印加することにより、面質 圧の印加によって選択された各面素部分を涌過する光変 調し、もって、基板4a又は4bの外側に文字、数字等 といった像を表示する。

【0031】以下、上記構成から成る液晶装置1を製造 するための製造方法について、図3に示す工程図を参照 にして説明する。

【0032】まず、図4に示すように、結晶パネル2を 構成する第1基板42の複数個分の大きさを有する大判 の第1基板母材18mの個々の液晶パネル基板部分4m に、図6 (a) に示すように、第1電極9a、配線バタ ーン15及び外部接続端子20をITOを材料として周 知のパターン形成法、何えばフォトリソグラフィー法に よって形成する (図3の工程P1)。図6 (a) におい て配線パターン15及び外部接続端子20の先端が集ま る領域が液晶駆動用IC3 (図1参照) を実装するため

【0033】次に、オーパーコート雇11a(図2券 照)を図4の第1基板母材18aの表面に、例えば酸化 珪素、酸化チタンを材料としてオフセット印刷によって 形成する(図3の工程P2)。そしてその上に、例えば ポリイミド系樹脂を材料としてオフセット印刷によって 配向膜12a (図2参照) を形成する (図3の工程P 3)。さらにその上に、例えばエポキシ系樹脂の中に導 通材を分散して成る材料を用いてスクリーン印刷によっ てシール材7を枠形状に形成する(図3の工程P4)。 これにより、図4に示すような、大判の第1基板母材1 8 a が形成される。なお、図 4 では、便宜上オーバーコ

一ト層及び配向膝の図示を省略してある。 【0034】他方、図5に示すように、液晶パネル2を 構成する第2基板4トの複数個分の大きさを有する大判 の第2基板母材18bの個々の液晶パネル基板部分4b に、図6(b)に示すように、第2電極9bをITOを 材料として周知のパターン形成法、例えばフォトリソグ ラフィー法によって形成する(図3の工程P5)。

【0035】次に、オーバーコート層11b (図2参 2の中に多数の導電粒子19を分散させることによって 40 照)を図5の第2基板母材18bの表面に、例えば酸化 珪素、酸化チタンを材料としてオフセット印刷によって 形成する(図3の工程P6)。そしてその上に、例えば ポリイミド系樹脂を材料としてオフセット印刷によって 配向膜12b (図2参照)を形成する (図3の工程P 7)。これにより、図5に示すような、大判の第2基板 母材18bが形成される。なお、図5では、便宜上オー バーコート層及び配向膜の図示を省略してある。

【0036】以上により、第1基板母材18a(図4) 及び第2基板母材18b(図5)が作製された後、図3 【0030】以上のように構成された液晶装置1に関し 50 の工程P8において、第1基板母材18aと第2基板母

7 材18bとをシール材7を間に挟んで重ね合わせ、さら に圧着すること、すなわち加熱下で加圧することによ り、両基板を互いに貼り合わせる。

【0037】この貼り合わせにより、第2基板4b上の 第2電極9bの先端(図6(b)参照)と、第1基板4 a上の配線パターン15 (図6 (a) 参照) とがシール 材7中に分散された導通材16(図2参照)によって互 いに導電接続される。以上により、液晶パネル2を複数 個含む大きさの大判パネル構造が形成される。なお、第 る際には、図4に示す第1基板母材18a又は図5に示 す第2基板母材18bのいずれか一方を図示の状態から 裏返した状態で他の基板母材と貼り合わす。

【0038】以上のようにして大判のパネル構造が作製 された後、このパネル構造に対して第1ブレイク工程を 実施する(図3の工程P9)。具体的には、パネル構造 を構成する第1基板母材18aに関して図4に示す第1 切断線 L10に沿って該基板母材を切断し、一方、第2 基板母材18bに関して図5に示す第1切断線1.11に 沿って該基板母材を切断する。

【0039】これにより、図7に示すように、短冊状の 第1基板母材18 a'及び短冊状の第2基板母材18 b'が互いに貼り合わされた状態の中判パネル構造 2' が複数個作製される。これらの中判パネル構造2'に関 しては、それらに含まれる各液晶パネル部分の液晶注入 口7aが外部へ露出する構造となっている。

【0040】なお、工程P9におけるパネル構造の切断 作業は、例えばスクライブ法、レーザカット法等を用い て行うことができる。スクライブ法は、切断線L10及 び切断線L11に沿ってスクライブ溝、すなわち切断溝 30 を形成し、パネル構造をそれらのスクライブ造の真側か ら叩くことにより、切断線L10及びL11の所でパネ ル構造を分断する方法である。

【0041】また、レーザカット法は、図8に模式的に 示すように、レーザ発射装置23から発射されるレーザ 光線、例えば赤外線レーザ光Rを第1基板母材18s▽ は第2基板母材18b上で矢印Aのように走査移動させ ることにより、そのレーザ光Rがあたった所から基板母 材18a又は18bを分断する方法である。

7) が作製された後、それに含まれる複数の液晶パネル 部分に関して、外部へ露出する液晶注入ロフェを涌して 液晶を注入し、さらにその注入の完了後にその液晶注入 口7aを樹脂によって封止する(図3の工程P10)。 【0043】その後、個々の液晶パネル部分のIC実装 領域」にACF17を貼着し、さらにそのACF17の 上に被晶駆動用[C3を貼着、すなわち仮装着し、さら に加熱された圧着ヘッドによってそれらの液晶駆動用Ⅰ C3を押圧することにより、各液晶パネル部分のIC実

【0044】次に、中判パネル構造2'に含まれる複数 個の液晶パネル部分を覆うことのできる大きさの中判偏 光板6 a ' 及び6 b ' を、それぞれ、中判の第1基板母 材18 a ' 及び第2基板母材18 b ' の外側表面に貼着 する (図3の工程P12)。そしてその後、工程P13 において中判パネル構造2'に対して第2プレイクを実 行する。

【0045】すなわち、図7において第2切断線L2に

1基板母材18aと第2基板母材18bとを貼り合わせ 10 沿って第1基板母材18a、及び第2基板母材18b、 の両方を偏光板6 a' 及び6 b' と一緒に切断し、これ により、図1に示す液晶装置1が1個ずつ分断される。 なお、この第2プレイクもスクライブ法、レーザカット 法等といった各種の切断法を用いて行うことができる が、望ましくはレーザカット法を利用して切断を行う。 【0046】レーザカット法を用いた方が望ましいこと の理由の第1は、偏光板6 a', 6 b'と基板18 a', 18b'との両方を支障なく正確に切断すること ができることである。また、その理由の第2は次の通り

20 である。すなわち、スクライブ法を用いる場合には、液 晶パネル基板の切断面にマイクロクラックと呼ばれる微 小なクラックが発生し、このマイクロクラックを基点と して液晶パネルに無型が発生するおそれがあるのに対 し、レーザカット法を用いると、液晶パネル基板の切断 面はスクライブ法を用いた場合に比べて著しく滑らかと なり、よって、液晶パネルの損傷を未然に防止できるか らである。

【0047】(その他の実施形態)以上、好ましい実施 形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形 態に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明 の範囲内で種々に改変できる。

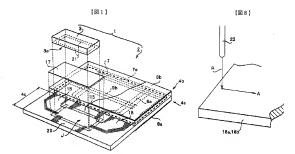
【0048】例えば、以上の説明では液晶駆動用IC3 を基板4 a 又は4 b の上に直接に実装する構造のCOG 方式の液晶装置を例示したが、液晶パネルを作製した後 にFPC (Flexible Printed Circuit) によって液晶脈 動用IC3を液晶パネルに接続する構造の液晶装置に関 して、液晶パネルを製造する工程において本発明を適用 することができる.

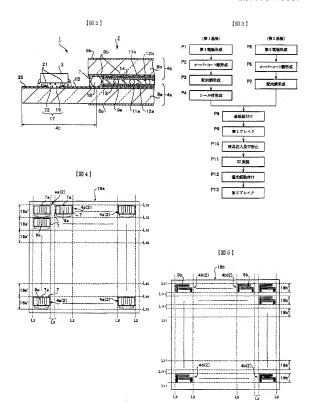
【0049】上記実施形態では図7に示すように、液晶 【0042】以上のようにして中判パネル構造2'(図 40 パネル複数個分の大きさの偏光板6a', 6b'を中判 のパネル構造2'に貼着し、その後に偏光板とパネル構 造2'の両方を一緒に切断することにしたが、図3の偏 光板貼付け工程(工程P12)において液晶パネル1個 分の大きさの偏光板を中判のパネル構造 2 ' の各液晶パ ネル部分の表裏両面に個別に貼着し、第2プレイクT程 (工程P13)ではパネル構造2'だけを切断するとい う実施形態も考えられる。

【発明の効果】本発明に係る液晶装置の製造方法によれ 装領域」に液晶駆動用IC3を実装する(図3の工程P 50 ば、液晶パネルが個々に分割された後にそれら個々の液

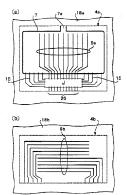
[0050]

	9			10
	晶パネルに偏光板が1個ずつ貼り付けられるのではな		2 '	中判パネル構造
	く、偏光板は中判パネル構造の状態の液晶パネルに対し		3	液晶駆動用IC
	て貼り付けられるので、液晶装置を製造する際の偏光板		3 a	能動面
	の貼付け工程が著しく簡略化され、よって液晶装置の製		4 a	第1基板
	造を簡単且つ迅速に行うことができる。		4 b	第2基板
	【図面の簡単な説明】		4 c	基板張出し部
	【図1】本発明に係る液晶装置の製造方法によって製造		6а, бъ	偏光板
	される液晶装置の一例を一部分解して示す斜視図であ		6а', 6 в'	中判偏光板
	ర .		7	シール材
	【図2】図1の液晶装置の要部の断面図である。	10	7 a	液晶注入口
	【図3】本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態		8 a	第1基板崇材
	を示す工程図である。		8 Ъ	第2基板素材
	【図4】図3の工程P1~P4を経て作製される第1基		9 a	第I電極
	板母材を示す平面図である。		9 Ъ	第2電極
	【図5】図3の工程P5~P7を経て作製される第2基		1 4	液晶
	板母材を示す平面図である。		1 5	配線パターン
	【図 6 】(a)は図 4 の液晶パネル 1 個分の部分を示		18 a	第1基板母材
	し、(b)は図5の液晶パネル1個分の部分を示す図で		18 a'	中判第1基板母材
	ある。		18 b	第2基板母材
	【図7】中判パネル構造の一例を一部分解して示す斜視	20	18 b'	中判第2基板母材
	図である。		2 0	外部接続端子
	【図8】基板のプレイク方法の一例であるレーザカット		J	IC実装領域
法を模式的に示す斜視図である。			L10, L1	1 第1切断線
	【符号の説明】		L 2	第2切断線
	1 液晶装置		R	レーザ光
	2 液晶パネル			









[図7]

